

走査型プローブ顕微鏡分科会のセミナーのお知らせ

主題 先端プローブ顕微鏡を活用したナノスケールの電気・オペランド計測

日時 9月7日(金)

場所 幕張メッセ 国際会議場 105 会議室

(JASIS コンファレンス 2018)

<https://www.jasis.jp/information/index.html>

プログラム

10:00～10:05 開会挨拶 井藤浩志 産業技術総合研究所

10:05～11:00 オペランドナノプローブ電位計測技術の開発と電池応用

藤田 大介 物質材料研究機構 拠点長

11:00～11:25 半導体中のキャリア濃度校正への取り組み

本田 暁紀 産業技術総合研究所

11:25～12:00 製品紹介/製品導入相談 SPM メーカー数社

12:00～14:00 昼食休憩・JASIS 展

14:00～14:05 事務連絡

14:05～14:55 ケルビンプローブ力顕微鏡の基礎と応用

小林 圭 京都大学

14:55～15:50 Scattering-type scanning near-field optical microscopy as a versatile tool for optical imaging and spectroscopy with nanoscale resolution

Aina Reich neaspec GmbH

15:50～16:20 走査ダイヤモンド NV 中心プローブを用いた局所磁気イメージング

安 東秀 北陸先端大学

16:20～16:30 事務連絡・閉会挨拶 井藤浩志 産業技術総合研究所

<http://microscopy.or.jp/bunkakai/>

<https://www.jasis.jp/regist/jp/jasisconfsrch.php>

(<http://www.nims.go.jp/project/amcp/spm/>)